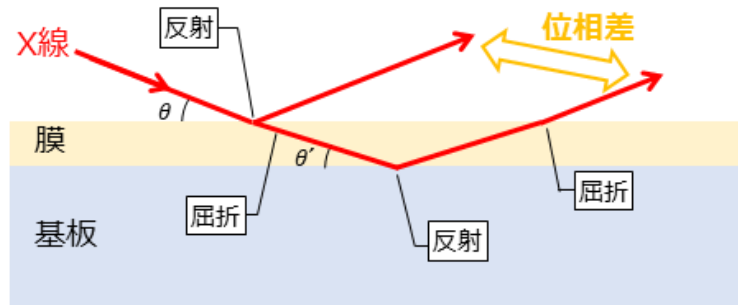


特徴

- ・ 多層膜の構造評価が可能
- ・ 結晶質・非晶質ともに適用可能
- ・ 非破壊

《測定原理》



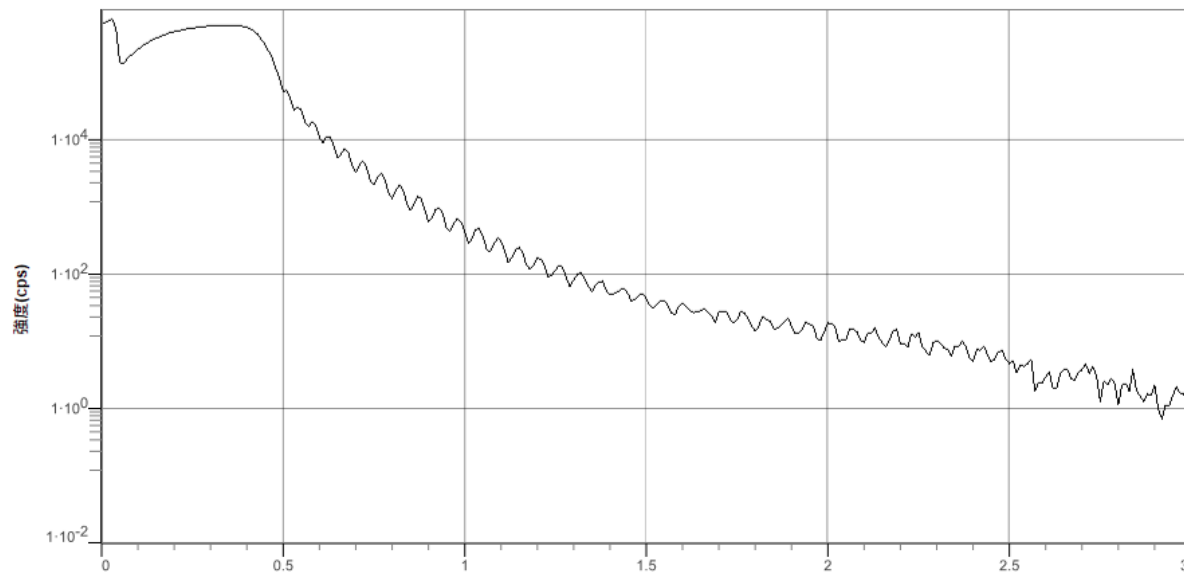
膜表面・基板表面で反射されたX線が干渉し
反射強度が振動

⇒ 解析により 膜厚, 粗さ, 密度 を取得

《XRR測定でわかること》

- ・ 1~1000nm程度の 膜厚
- ・ 表面および界面の 粗さ
- ・ 各層の 密度

〈XRRプロファイル〉



膜構成	膜厚(nm)	密度(g/cm ³)	粗さ(nm)
DLC	147.584	1.70493	0.914
Si (基板)	-	2.32924	0.140